Индивидуальная Корзина Для Очистки Пластин Из Ptfe, Коррозионностойкая, Невыщелачивающая, Опора Для Экспериментов С Высокомолекулярными Соединениями

Артикул: PL-CP264

введение

Высокопроизводительные индивидуальные держатели пластин и корзины для очистки из PTFE, предназначенные для полупроводниковых и полимерных исследований. Благодаря выдающейся коррозионной стойкости и свойствам нулевого выщелачивания эти индивидуальные решения обеспечивают обработку без загрязнений в сложных химических средах для современных высокоточных лабораторных и промышленных применений.

Узнать больше

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Мокрое травление в полупроводниковой промышленности	Фиксация кремниевых пластин во время травления на основе кислот для удаления оксидов или формирования рисунков.	Химическая инертность предотвращает загрязнение ванны.
Анализ следовых количеств металлов	Очистка лабораторной посуды и образцов в высокочистых кислотных ваннах для экологических или геологических исследований.	Отсутствие выщелачивания металлов гарантирует точность анализа.
Синтез полимеров	Поддержка носителей катализатора или подложек при высокотемпературных реакциях в среде растворителей.	Высокая термическая стойкость и антиприлипающая поверхность.
Производство солнечных элементов	Транспортировка крупноформатных кремниевых подложек через многостадийные ванны очистки и текстурирования.	Прочная конструкция для высокопроизводительного потока.
Очистка в фармацевтике	Стерилизация и очистка деликатных стеклянных или металлических компонентов в агрессивных моющих растворах.	Соответствие стандартам высокой чистоты и отсутствия загрязнений.
Электрохимическое осаждение	Фиксация подложек во время гальванического покрытия или осаждения металла в коррозионных электролитных растворах.	Электрическая изоляция и химическая стабильность.
Обработка оптоэлектронных компонентов	Очистка и транспортировка стеклянных или сапфировых подложек для производства светодиодов и лазерных диодов.	Безцарапинная транспортировка и ополаскивание без остатков.
Высокотемпературная сушка	Перемещение пластин из мокрых ванн напрямую в нагретые сушильные камеры или печи.	Сохраняет структурную целостность при температуре до 260°C.

Особенность	Детали спецификации (серия PL-CP264)
Идентификатор продукта	Индивидуальный держатель пластин PL-CP264
Основной материал	Высокочистый первичный PTFE (опционально доступен PFA)
Статус кастомизации	100% индивидуальное изготовление под заказ
Диапазон температур	-200°C до +260°C (-328°F до +500°F)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Особенность	**Детали спецификации (серия PL-CP264)**	
Химическая совместимость	Универсальная (все кислоты, основания, растворители, кроме расплавленных щелочных металлов)	
Конфигурация пазов	Настраиваемая (ширина, шаг, угол и глубина)	
Совместимость с пластинами	Индивидуальные размеры для 1", 2", 4", 6", 8", 12" или нестандартных форм	
Метод изготовления	Высокоточная обработка на станке с ЧПУ	
Отделка поверхности	Гладкая, низкофрикционная, непористая	
Варианты ручек	Интегрированные, съемные или интерфейс для робота	
Парковая емкость	Разработка по спецификации пользователя (одна или несколько пластин)	